

Title	熱応力解析に基づくガラスのレーザスクライブ機構の解明と亀裂進展条件の推定
Author(s)	山本, 幸司
Citation	大阪大学, 2009, 博士論文
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/49512
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

Osaka University

【63】

氏 名	やま もと こう じ 山 本 幸 司
博士の専攻分野の名称	博 士 (工 学)
学 位 記 番 号	第 2 2 9 5 4 号
学 位 授 与 年 月 日	平 成 2 1 年 3 月 2 4 日
学 位 授 与 の 要 件	学位規則第4条第1項該当 工学研究科マテリアル生産科学専攻
学 位 論 文 名	熱応力解析に基づくガラスのレーザスクライブ機構の解明と亀裂進展条件の推定
論 文 審 査 委 員	(主査) 准教授 大村 悦二 (副査) 教 授 平田 好則 教 授 片山 聖二 教 授 伊東 一良 准教授 阿部 信行

論文内容の要旨

CO₂レーザー照射直後を冷却するレーザースクライブは、パーティクル発生の抑制とガラスエッジ強度の向上というフラットパネルディスプレイ製造の要求を満たす加工法である。しかし、基礎現象の解析がなされておらず、亀裂が進展する加工メカニズムやその適用範囲が明らかにされていなかった。そこで、本研究では、レーザースクライブの信頼性と加工品質の向上、普及の促進を実現するため、レーザー照射実験と有限要素法による熱弾性解析を行い、レーザースクライブ機構を解明した。また、亀裂進展条件が熱応力解析によって簡易に推定できることを示した。以下に、各章の概要を示す。

第1章では、研究の背景、および目的と意義について述べた。

第2章では、板厚0.7 mmのソーダガラス基板を用いたレーザー照射実験に基づく三次元熱弾性解析を行って、レーザー照射によりガラス基板表面が加熱され、その直後の冷却により表層に引張応力が発生して亀裂が進行するレーザースクライブ機構を解明した。表層の引張応力は冷却域内部に生じた圧縮応力場によって助長されることを示した。また、熱応力解析によってスクライブ可能条件を冷却域の表面最大引張応力と加熱域の表面最高到達温度から推定できることを示した。二次元解析によってスクライブ可能条件を推定の方が実用的であることも示した。

第3章では、液晶ディスプレイ（LCD）用ガラス基板の薄板化を考慮し、板厚1.1 mm以下のソーダガラス基板を用いてレーザー照射実験と二次元熱弾性解析を行い、板厚が0.4～1.1 mmであれば板厚に関わらずスクライブ可能条件を推定できることを示した。また、それぞれのスクライブ条件において、冷却域の表面最大引張応力が極大となる板厚が存在し、その板厚は、スクライブ速度が高速になると薄くなる傾向があることを明らかにした。次に、線膨張係数がソーダガラスより小さいLCD用のアルミノシリケートガラスにおいてもスクライブ可能条件を推定できることを示した。線膨張係数が $4.2 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ 以上で、軟化点や耐熱温度が975 °C程度以上の硬脆性材料であれば、レーザースクライブができる可能性があることを明らかにした。

第4章では、レーザークロススクライブ実験と三次元熱弾性解析を行い、2次スクライブによって1次スクライブ面が圧接される場合と、2次スクライブの冷却域で1次スクライブ面に生じる摩擦力によってスクライブを進行させる引張応力が伝達される場合の二つの形態で、1次スクライブ線のエッジに初期亀裂を導入していないにも関わらず、2次スクライブが進行することを明らかにした。

第5章では、第2章のレーザースクライブ機構に基づいて、冷却域内部に生じた圧縮応力場を低減すると亀裂が深くなると推測して、レーザー照射を局所的に遮へいしてスクライブ実験を行い、遮へい領域で亀裂が深くなり、遮へい中心で亀裂深さが最大となることを示した。次に、三次元熱応力解析を行い、亀裂が深くなるのは、亀裂の進展を阻害する内部の圧縮応力場が減少、もしくは引張応力場に転じたときに生じることを解明した。

第6章では、レーザー重ね照射実験と二次元熱弾性解析を行って、ガラス基板表層に大きな圧縮応力が生じ、その影響を受けてガラス基板内部に発生した引張応力が亀裂先端に集中することによって、レーザースクライブ亀裂が深さ方向に伸長することを解明した。また、亀裂が伸長するレーザー重ね照射条件を推定できることを示した。

第7章では、本研究で得られた結果を総括した。

論文審査の結果の要旨

本論文は、フラットパネルディスプレイ（FPD）製造プロセスで多用されつつあるガラスのレーザースクライブについて、加工メカニズムの解明と亀裂進展条件の推定を目的として行われた一連の研究結果をまとめたものである。具体的には、(1) ガラスのレーザースクライブ機構、(2) レーザースクライブにおける板厚と線膨張係数の影響、(3) レーザクロススクライブ機構、(4) 亀裂の局所進展スクライブ、(5) レーザー重ね照射によるレーザースクライブ亀裂伸長の五つのテーマを取り上げ、レーザー照射実験と有限要素法による熱弾性解析を行っている。

ガラスのレーザースクライブ機構については、レーザー照射によりガラス表面近傍が圧縮状態になった後、直後のウォータージェットによる冷却によって表層が冷却され、表層に引張応力が発生して亀裂が進行することを明らかにしている。表層の引張応力は冷却域内部に生じた圧縮応力場によって助長されること、レーザー照射領域と冷却域の距離が短

くなると、内部の圧縮応力が大きいまま浅く位置するようになり、垂直亀裂がこの圧縮場のために湾曲することも示している。また、実験結果に基づいて熱応力解析を行えば、冷却域の表面最大引張応力の下限値と加熱域の表面最高到達温度の上限値から、レーザースクライブ可能条件を推定できることを示している。このレーザースクライブ可能条件の推定方法は、板厚が0.4～1.1 mmであれば板厚に関わらず適用できること、線膨張係数がソーダガラスより小さい液晶ディスプレイ用アルミノシリケートガラスにも適用できることを示している。このことを踏まえて、セラミックスなどの硬脆材料のレーザースクライブ可能性についても言及し、アルミナセラミックについて実験で実証している。

レーザークロススクライブでは、1次スクライブ線のエッジに初期亀裂を導入していないにも関わらず、2次スクライブが進行する。この2次スクライブの進行メカニズムとして、2次スクライブの加熱域で1次スクライブ面が圧接される場合と、2次スクライブの冷却域において、1次スクライブ面に生じる摩擦力によって引張応力が伝達される場合の二つの形態があることを示している。

さらに、前述のレーザースクライブ機構に基づいて、レーザー照射の一部を遮へいすることで冷却域内部に生じた圧縮応力場を低減して、遮へい領域の垂直亀裂を局所的に深くする方法を提案し、実験によって実証している。三次元熱弾性解析によってそのメカニズムを明らかにしている。また、レーザースクライブ後にスクライブ線に沿ってレーザーの重ね照射を行うと、レーザースクライブ亀裂が深さ方向に伸長することを実験的に示している。熱弾性解析によって、ガラス表層に大きな圧縮応力が生じ、ガラス内部に発生した引張応力が亀裂先端に集中することでレーザースクライブ亀裂が伸長するメカニズムを明らかにしている。亀裂が伸張するレーザー重ね照射条件を推定できることも示している。

以上のように、本研究によってレーザースクライブ機構が解明され、亀裂進展条件が簡易に推定できるようになったことは、ガラスのレーザースクライブの信頼性と加工品質の向上、普及促進につながる。明らかになったレーザースクライブ機構や亀裂進展条件の推定方法は、レーザースクライブを一般の脆性材料に適用する際の指針にもなり、レーザースクライブが、FPD 製造におけるガラス基板分断工程に限らず、さまざまな分野において適用されるようになることが期待される。このように、本論文における一連の研究結果は、学術面での独創性と完結性、ならびに工業的有用性が認められ、生産科学と生産加工の分野へ寄与するところが大きい。よって論文は博士論文として価値あるものと認める。